邀請函 INVITATION

高解析 × 高速度：先進 SEM・EDS・EBSD 分析技術研討會

隨著 AI 與半導體產業的蓬勃發展，以及先進製程技術的快速演進，材料觀察正朝向多尺度與多維度發展，也對 SEM、EDS 與 EBSD 的高解析度與高速分析能力提出前所未有的挑戰。一方面，材料結構持續微型化、奈米化；另一方面，大尺寸樣品的外觀檢查與缺陷分析需求亦同步提升。

在實際分析中，您是否也曾面臨以下問題?

- **從奈米到巨觀**：如何最佳化 SEM 觀察條件與偵測器配置?
- 如何在 SEM-EDS 分析中**實現奈米級 EDS mapping**？面對電子束敏感樣品，表面起伏較大的樣品等極具挑戰樣品，如何獲得更好的 EDS 結果?
- 在 EBSD 表徵上，**低電壓、高解析、高速度、in-situ 及 3D EBSD** 是否真能兼顧並同時實現?

為協助您突破上述分析瓶頸，國立臺灣大學貴重儀器中心與布魯克公司（Bruker）、EHong 公司誠摯邀請您參加於臺灣大學舉辦的「高解析 × 高速度：先進 SEM・EDS・EBSD 分析技術研討會」。

另外，本次研討會特邀用戶真實樣品，於會中進行 **on-line 即時 EBSD 測試展示**。與會者將可零距離、同步觀測 EBSD 分析全流程，親身感受史上速度最快的 EBSD 技術，**不再只是簡報，而是真實應用的極限體驗**!

會議時間：2026 年 1 月 22 日（四）13：00-16：40
會議地點：台大思亮舘國際會議廳
日程表：

13:00-13:20	Registration
13:25-13:30	Opening
13:30-14:10	HITACHI 高階場發射掃描式電子顯微鏡之介紹與應用 益弘儀器 產品經理 陳哲逸
14:10-14:50	SEM 中實現亞 10nm 級與 10ppm 級 EDS 分析 ——平插式 EDS FlatQUAD 與 X-ray 微區熒光光譜儀 XTrace 布魯克公司 銷售經理 黃春妮
14:50-15:10	Coffee Break
15:10-16:00	新世代高效能直接電子探測 EBSD 技術介紹與應用 ——EBSD 4.0：DED 技術 EBSD eWARP 布魯克公司 應用科學家 陽金華 博士
16:00-16:20	Bruker EBSD eWARP Live Demo
16:20-16:40	Q & A

暖心說明：
免費參加，人滿即止
咨詢電話：
布魯克公司 黃小姐，0966723795
益弘儀器 許小姐 /Kelly@ehong.com.tw/ 02-27552266#310
報名連結：
https://forms.gle/By3wRuXJvVXUJvVM7
或者請您掃描右側二維碼報名

主辦單位： Bruker 布魯克公司 , HITACHI 日立 (益弘儀器), 國立台灣大學理學院電顯中心 協辦